

Measurement for Nano and Micro Device

奈微米元件量測實驗 (NEMS5110)

		Cheng	Wang	Lai	Li	Fu	Chen	Lo	
Exp. 1	2月22日	OK	OK					OK	Cheng
	3月1日	OK	OK					OK	
	3月8日	OK	OK			OK		OK	
Exp. 2	3月15日	OK	OK			OK		OK	Wang
	3月22日		OK		OK	OK		OK	
	3月29日		OK		OK	OK		OK	
	4月5日	彈性放假 Holiday							
Exp. 3	4月12日			OK	OK	OK		OK	Fu
	4月19日			OK	OK	OK		OK	
	4月26日		OK	OK	OK	OK		OK	
Exp. 4	5月3日		OK	OK	OK	OK		OK	Lo
	5月10日			OK	OK		OK		
	5月17日			OK	OK		OK		
Exp. 5	5月24日		OK				OK		Chen
	5月31日		OK				OK	OK	
	6月7日	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
	6月14日	期末考 Final examination							
	6月21日	成績公布 Grade announcement							
	6月28日	成績繳交學校 Pass the grade to NTHU							
red color: Oral lecture during 10:10 - 12:00.									

Measurement for Nano and Micro Device
奈微米元件量測實驗
(NEMS5110)

1. The first class for course announcement starts 10:10 on **Feb. 22 (Friday)**. **Please do attend.**
2. Please download the experimental manual from Website (Link: mx.nthu.edu.tw/~chengyao).
3. General TA – Mr. Liao (廖冠勳, #80128, s9935804@m99.nthu.edu.tw)
Exp. TA – See following pages.
4. Grading: Five experimental reports and class participation (70%) and final exam (30%).
5. Lectures for all four groups: **F3F4 (10:10~12:00)**
Experiment:
 - 1st group: MaMb (18:20~20:10)
 - 2nd group : T9Ta (17:20~19:10)
 - 3rd group: W9Wa (17:20~19:10)
 - 4th group: R9Ra (17:20~19:10)
6. **Final exam: Jun. 14, 10:10-12:00.**
7. The deadline for uploading homework: Follow lecture's instructions.

Measurement for Nano and Micro Device

奈微米元件量測實驗

(NEMS5110)

教師 Lecture	實驗名稱 Experiment	實驗課程大綱 Syllabus	使用儀器項目 Training Tool	助教 TA
羅丞曜 C. Y. Lo	光學薄膜量測 Optical Thin Film Meas.	多層膜光學 Multilayer Optics 系統模擬 Simulation 實作 Practice	積分球儀 Integration sphere	K. Kashyap A. Kumar #62402 #62403
鄭兆珉 C. M. Cheng	生化反應量測 Anal. ELISA-based Detections	酵素免疫吸附測定法 Enzyme-Linked Immunosorbent Assay 量測方式 Meas. Approach 實作 Practice	掃描器 Scanner	羅士杰 Mr. Lo #80632
陳致真 C. C. Chen	DNA量測 DNA meas.	微流道系統 Microfluidics sys. 電泳系統 Electrophoretic sys.	生化分析儀 Biomedical analy.	陳映竹 Ms. Chen #80636

教師
Lecture

實驗名稱
Experiment

實驗課程大綱
Syllabus

使用儀器項目
Training Tool

助教
TA

王玉麟
Y. L. Wang

半導體元件量測
Semi. dev. meas.

半導體量測介紹
Introduction
實作
Practice

半導體參數分析儀
Semiconductor
parameter
analyzer

許振彬
Mr. Hsu
#80159

傅建中
C. C. Fu

微結構幾何形狀
量測實驗
Microstructure
geometry
measurement

電子顯微鏡原理
Intro. electron-
microscope
共軛焦顯微鏡
Confocal microscope

共軛焦顯微鏡
Confocal microscope

張恩獎
Mr. Chang
黃則斌
Mr. Huang
#80637